깪

电子科技大学 2020-2021 学年第二学期 期中考试

考试科目: <u>半导体物理 A</u>考试形式: <u>闭卷</u>考试日期: <u>2021</u>年<u>5</u>月<u>11</u>日 本试卷由 四 部分构成, 共 6 页。考试时长: 95 分钟 注: 可使用非存储功能的计算 器

成绩构成比例:平时成绩_35%,期末_65%

题号	_	11	151	四	合计
得分					

(可能用到的物理常量: 玻尔兹曼常数 $k = 8.62 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$; 基本电荷量: q $= 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

得	分	

一、选择题(共30分。每空仅有唯一答案;每空1分)

1. 现有两种不同的半导体材料甲和乙,在导带底极值点处,若甲材料的曲率半径更大,则 两种材料的电子有效质量为:甲()乙;若甲的空穴有效质量比乙的大,则低电场下 两种材料的空穴漂移速度关系为:甲()乙。

A. >

 $B_{\cdot} = C_{\cdot} <$

答案 AC

2. 由两种()原子的()立方,沿立方的体对角线错开其长度的 1/4 套构而成的晶体结 构称为闪锌矿型结构。

A. 相同

B. 不同

C. 面心

D. 体心

答案 BC

3. 本征半导体与非本征半导体的最主要区别在于()的位置。对于相同掺杂浓度、不同 杂质类型的 p 型杂质半导体, 若在相同温度下空穴越多, 则其受主杂质电离能越(

A. *E*_F 的位置

B. *E*_i 的位置

C. 大 D. 小

答案 AD

4. 关于室温下非简并 p 型硅样品,下列描述正确的是 ()

器_

电子科技大学 2020-2021 学年第二学期 期中考试

考试科目: 半导体物理 A 考试形式: 闭卷 考试日期: 2021 年 5 月 11 日 本试卷由 四 部分构成, 共 6 页。考试时长: 95 分钟 注: 可使用非存储功能的计算

成绩构成比例:平时成绩_35%,期末_65%

题号	_	11	151	四	合计
得分					

(可能用到的物理常量: 玻尔兹曼常数 $k = 8.62 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$; 基本电荷量: q $= 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

得 分

一、选择题(共30分。每空仅有唯一答案;每空1分)

1. 现有两种不同的半导体材料甲和乙,在导带底极值点处,若甲材料的曲率半径更大,则 两种材料的空穴漂移速度关系为: 甲(←)乙。

A. >

B. =

C. <

答案 AC

2. 由两种(沿立方的体对角线错开其长度的 1/4 套构而成的晶体结 型结构。

A. 相同

B. 不同

D. 体心

答案 BC

杂质类型的 p 型杂质半导体, 若在相同温度下空穴越多,

A. *E*_F 的位置

B. *E*_i 的位置

C. 大

D. 小

答案 AD

4. 关于室温下非简并p型硅样品,下列描述正确的是



(B.) 光照产生的电子空穴对增多时,其电子准费米能级更远离价带顶能级
C. 掺杂浓度越高, 其费米能级越远离导带底能级
D. 与室温下相同掺杂浓度的 n 型硅样品相比, 其费米能级离本征费米能级更近
答案 C
5. 在相同温度下,宽禁带半导体比硅具有更(人)的本征载流子浓度,更(人)的本征温度。
A. 低 B. 高
答案 A B
6. 室温下,本征半导体中电子占据费米能级 $E_{\rm F}$ 的概率为($lacksymbol{\square}$); 电子占据杂质能级 $E_{\rm D}$ 的
概率为() A. 0 B. 1/2 C. 1/3 D. 2/3
A. 0
8. 一般高速开关器件中采用的载流子为)。 (
A. 平衡多子空穴 B. 平衡多子电子 C. 非平衡空穴 D. 平衡电子
3
答案 B
10. 若温度从 250 K 升高至 300 K, n 型硅中的电离杂质散射概率及其对应的迁移率将分别
其晶格振动散射概率和对觉的迁移率将分别是()。
A. 变小、变大 B. 变大、变小
C. 变小、变小 D. 变大 变大
答案: AB
11. 在一定的温度下,掺杂浓度高的半导体通常具有较()的迁移率,这主要是由)
导致的。
A. 低 B. 高 C. 电离杂质散射 D. 晶格振动散射
答案: AC
12. Si 材料载流子迁移率随电场增加而),是因为载流子与晶格发生了(),进一步
增强电场,载流子平均漂移速度先)后((),这是由于载流子与晶格发生了(())。
A. 增加 B. 降低 C. 饱和 D. 光学波散射 E. 声学波散射 F. 电离杂质散射
答案: BEACD
13. GaAs 材料而言,负微分电导是由于电子发生(),迁移率()。 A. 光学波散射 B. 电离杂质散射 C. 谷间散射 D. 变大 E. 变小 F. 不变
答案: CE 14. 对工,刑业已体,在小注)的特况下,多之准弗业的现在小之弗业的领力(
14. 对于 p 型半导体,在小注入的情况下,多子准费米能级在少子费米能级之() 多子准费米能级比少子准费米能级更() 衡费米能级。

A. 温度增加, 其费米能级将远离本征费米能级

腳

A. 上 B. 下 C. 靠近 D. 远离

答案: BC

15. 导带中的电子直接落入价带与空穴复合的过程称(), 而通过复合中心的进行的复合 称为(); 涉及到三粒子效应的复合是 (), 它是一种非辐射复合过程。

A. 间接复合:

- B. 直接复合;
- C. 俄歇复合;
- D. 辐射复合

答案: BCA

16. 当样品厚度小于扩散长度时,在样品一端注入事平衡载流子,其浓度在样品内呈(此时,非平衡载流子在样品中发生的复合效应()。

A. 指数衰减分布 B. 线性衰减分布

C.可忽略

D.不可忽略

答案: CD

得 分

二、简答题(每小题8分,共24分)

1. 硅样品中的掺杂剂可以是硼原子或砷原子,也可以是金原子。试问二者对半导体电学特性的影响,并比较二者的不同应用。

答:

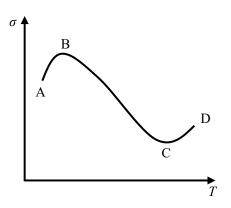
- - (2) 硅中掺杂金原子一般形成深能级杂质。在常温下深能级杂质较难电离,并且和浅能级杂质相比,掺杂浓度不高,故对载流子的浓度影响不大,但在半导体中可以起有效的复合中心或陷阱作用,对载流子的复合作用很强。(3分)
 - (3)在实际的应用中,通过浅能级杂质调节载流子的浓度、电阻率,改变材料的导电类型。而通过深能级杂质提供有效的复合中心,提高器件的开关速度。(2分)
 - 2. 下图给出中等掺杂 p 型硅的电阻率随温度的变化关系曲线,解释说明 AB 段、BC 段以及 CD 段的变化规律及其原因,并说明 C 点和 D 点的温度由哪些因素决定。

解释原因 (6分)

AB段: 低温区弱电离区。杂质电离使 $n \uparrow$; 电离杂质为主, $T \uparrow$, $\mu \uparrow$, 电导率 \uparrow 。(2分)

BC段: 全电离区。n不变化; 晶格散射为主,T ↑, μ ↓,电导率 ↓. (2分)

CD段:本征区。本证载流子导电为主,ni随温度迅速



升高,μ缓慢降低,电导率单调增加. (2分)

C、D点温度由禁带宽度和掺杂浓度决定,随着二者的升高而升高。(2分)

- 3. 请给出非平衡状态下,半导体中电子总电流和空穴总电流的表达式。
- 答: 半导体器件中有四种电流成分:

① 电子扩散电流
$$(J_n)_{Dif} = -qS_n = qD_n \frac{d\Delta n(x)}{dx}$$
 (2分)

② 电子漂移电流 $(J_n)_{Drf} = qn\mu_n E = q(n_0 + \Delta n)\mu_n E$ (2分)

或直接写出电子总电流为 $J_n = qD_n d\Delta n(x)/dx + q(n_0 + \Delta n(x))\mu_n E$

④ 空穴漂移电流 $(J_p)_{Drf} = qp\mu_p E = q(p_0 + \Delta p)\mu_p E$ (2分)

或直接写出空穴总电流为 $J_p = -qD_p d\Delta p(x)/dx + q(p_0 + \Delta p(x))\mu_p E$

得 分

三、证明题 (共 10 分)

证明处于热平衡状态下,半导体中的电子迁移率及其扩散系数满足爱因斯坦关系。

解:对于非均匀的n型半导体,在热平衡状态下其净电流为零,即

$$J_{\rm n}=J_{\rm n\,\scriptscriptstyle ;\!\scriptscriptstyle |\!\scriptscriptstyle |\!\scriptscriptstyle |\!\scriptscriptstyle |}+J_{\rm p\,\scriptscriptstyle |\!\scriptscriptstyle |\!\scriptscriptstyle |\!\scriptscriptstyle |\!\scriptscriptstyle |}=0$$

$$(-q) \cdot n_0(x) \mu_n(-E) + (-q) \cdot D_n (-dn_0(x)/dx) = 0 \dots (1)$$
 (2 $\%$)

电场由扩散引起,内部存在关系:

曲(1)
$$dn_0(x)/dx = -\mu_n/D_n \cdot n_0(x)\mu_n E$$
.....(3) (2 分)

 $n_0(x) = N_c \exp[-(E_c - E_F)/k_0 T] = N_c \exp[-(E_c - qV(x) - E_F)/k_0 T] \dots (2)$

由(2)
$$dn_0(x)/dx = n_0(x) q/k_0 T \cdot dV(x)/dx$$
.....(4) (2 分)

又因为E(x) = -dV(x)/dx

联系(3)和(4)可得爱因斯坦关系式: $D_n = (k_0 T/q) \mu_n$ (2 分

$$\frac{dh}{dx} = \frac{1}{2} \frac{1}{2}$$

(2分)

Ec (x) = Ec - 2V(x)

得 分

四、计算题与综合题 (每小题 12 分, 共 36 分)

- 1.一块硅材料中掺磷浓度为 1×10^{16} cm⁻³,假设杂质全电离且电子迁移率 1200 cm²/V·s。已知电导有效质量 $m_c = 0.26m_0$ ($m_0 = 9.1\times10^{-31}$ kg)。
- (1) 求该半导体材料的电阻率; (2) 加一强度为 10⁴ V/m 的电场, 求平均自由时间和平均自由程。

解.

$$\rho = \frac{1}{qn\mu_n} = \frac{1}{1.602 \times 10^{-19} \times 1 \times 10^{16} \times 1200}$$

 $(1) = 0.52\Omega \cdot cm$

(4分:公式3分答案1分)

 $\tau_n = m_c \mu_N / q = 0.12 \times 0.26 \times 9.1 \times 10^{-31} / (1.602 \times 10^{-19}) = 1.77 \times 10^{-13} s$ (2 \(\frac{4}{1}\))

平均漂移速度为

$$\overline{v} = \mu_N E = 0.12 \times 10^4 = 1.2 \times 10^3 \, m \, / \, s$$

16 - UZ

平均自由程为

$$\overline{l} = \overline{v}\tau_n = 1.2 \times 10^3 \times 1.77 \times 10^{-13} = 2.12 \times 10^{-10} m$$
 (2 \(\frac{1}{2}\))

 cm^3 (2分) $0 = -\frac{\Delta n}{2} + ?$

由于在 p 型区内载流子的复合可忽略,则非平衡少子浓度沿 p 型半导体区呈线性分布,体内的扩散电流处处相等,且非平衡电子与非平衡空穴的浓度梯度相等: (2分)

 $d(\Delta n)/dx = d(\Delta p)/dx = (\Delta n)_0/W = 10^{15}/(10 \times 10^{-4}) = 10^{18} \text{ cm}^{-4} (2 \%)$

因此, 在 $x = 5 \mu m$ 处的扩散电流密度为:

$$(J_{\text{diff}})_{n} = qD_{n} \times d(\Delta n)/dx = 1.6 \times 10^{-19} \times 40 \times 10^{18} = 6.4 \text{ A/cm}^{2} (2 \%)$$

$$(J_{\text{diff}})_{p} = -qD_{p} \times d(\Delta p)/dx = -1.6 \times 10^{-19} \times 10 \times 10^{18} = 1.6 \text{ A/cm}^{2} (2 \%)$$

$$J_{\text{diff}} = (J_{\text{diff}})_{n} + (J_{\text{diff}})_{p} = 6.4 - 1.6 = 4.8 \text{ A/cm}^{2} (2 \%)$$

3. 已知硅和 4H-碳化硅材料的重要物理参数如下表所示。

	禁带宽度 (eV)	饱和漂移速度 (10 ⁷ cm/s)	临界击穿电场 (MV/cm)	热导率 (W/cm·K)
Si	1.12	1	0.3	1.7
4H-SiC	3.26	2	3	4.9

综合《半导体物理 A》课程相关知识,试比较并解释 4H-碳化硅材料与硅材料在制作电子 器件的潜在优势。

答题提示:

物理参数	知识点 (概念/公式/能带图等)
禁带宽度	禁带宽度越大,相同温度下本征载流子浓度越低,则本征温度越高,
	更有利于制作高温器件。4H-SiC 的禁带宽度对应的能量为紫外光,
	可用于制作紫外探测器的材料。此外,宽禁带半导体制成的可制作
	具有抗辐照更好的器件,适用于航空航天领域所需的器件。(3分)
饱和速度	4H-SiC 中的饱和漂移速度是 Si 中的两倍,因此具有更快的漂移速
	度,有利于制作高频/高速器件。(3分)
临界击穿电场	4H-SiC 是 Si 的 10 倍, 因此在高耐压器件方面有更好的应用。比如
	制作大功率电力电子器件。(3分)
热导率	4H-SiC 具有更大的热导率,因此其散热更好,有利于制作高温器
	件。(3分)